

微小電流測定用マニュアルプローバ

- ・ガードとシールドの三重構造により、fAレベルの微小電流測定が可能。
- ・ガード構造の徹底で、低雑音・高精度測定を実現。
- ・エアベアリングステージ採用により、片手で簡単に操作可能。
- ・3段切り替えレバーによるセーフティロック機構を搭載。コンタクト時の操作ミスによるデバイスやプローブの損傷を防止。
- ・サーモチャック (-50°C~+200°C ドライエアパージによる結露防止機構あり) またはホットチャック (+40°C~+200°C) を用いた温度依存特性評価が可能。
- ・使用目的に合わせたカスタマイズが可能。

708fT仕様

最大ウェーハサイズ	φ200mm
ステージ移動範囲(粗動)	X:220mm Y:270mm
ステージ移動範囲(微動)	X:10mm Y:10mm
Z軸 ステージストローク	0 / 0.3 / 3.5mm + 3mm
θ軸 ステージ回転角度	±5°
外形寸法(W×D×H)	897 × 863 × 400mm(オプション含まず)
装置重量	120kg(オプション含まず)

708fT Options

- ・マイクロマニピュレータ
- ・同軸プローブ・精密プローブ針
- ・同軸ケーブル
- ・変換コネクタ
- ・温度コントローラ・サーモチャック・ホットチャック
- ・顕微鏡・CCDカメラ



Manual prober for low current measurement

- The three-layer structure with guard and shield allows measurement of fA-level low current.
- Fully guarded structures provide low noise and high accuracy measurement.
- Air bearing stage for easy one-handed operation.
- 3-step adjustment lever with safety-lock mechanism to prevent damage to devices and probes caused by improper contact operation.
- Can be equipped with thermal chuck (-50°C to +200°C dew condensation prevention mechanism with dry air purge) or hot chuck (+40°C to +200°C) for evaluation of temperature-dependent properties.
- Customizable according to intended use.

708fT Specifications

Maximum wafer size	φ 200 mm
Stage travel (rough adjustment)	X : 220 mm Y : 270 mm
Sub-stage travel (fine adjustment)	X : 10 mm Y : 10 mm
Z stroke	0 / 0.3 / 3.5 mm + 3 mm
θ travel	±5°
External dimension (W x D x H)	897 × 863 × 400 mm (excluding options)
Weight	120 kg (excluding options)

708fT Options

- Micro manipulators
- Coaxial probes and precision probe needles
- Coaxial cables
- Conversion connectors
- Temperature controllers, thermal chucks and hot chucks
- Microscopes and CCD camera

